

УДК 621.362

## СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ Mg<sub>2</sub>Si-Mg<sub>2</sub>Sn ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕННЫХ ЧАСТИЦ SiO<sub>2</sub>

Самусевич К.Л.<sup>1</sup>, Баранник И.С.<sup>1</sup>, Ермолаев Д.В.<sup>1</sup>

Научный руководитель: Исаченко Г.Н.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Университет ИТМО, Санкт-Петербург

<sup>2</sup>Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

Главным критерием отражающим эффективность термоэлектрических материалов является коэффициент термоэлектрической добротности, который зависит от значения коэффициентов термоэдс, электропроводности и теплопроводности. Перечисленные параметры взаимозависимы, поэтому основной задачей при исследовании термоэлектриков является изучение методов и возможностей раздельного воздействия на эти параметры и оптимизацию свойств через зонную и фононную инженерию. Рост эффективности термоэлектрических материалов достигается через увеличение плотности состояний и подавления теплового потока с минимальным воздействием на подвижность носителей заряда [1].

Одним из таких возможных механизмов является внедрение или естественное формирование второй фазы, размеры которой сопоставимы с размерами элементарной ячейки. Возмущения в кристаллической решётке вызванные такими включениями выступают дополнительными рассеивающими центрами, приводя к снижению теплопроводности. Теоретические расчеты предсказывают значительное увеличение термоэлектрической добротности за счет снижения теплопроводности [2], экспериментальные же результаты достаточно противоречивы [3].

В данной работе исследуется эффективность снижения теплопроводности и комплексное влияние на термоэлектрическую добротность в твёрдых растворах Mg<sub>2</sub>Si-Mg<sub>2</sub>Sn дырочного типа проводимости за счет внедрения примесей SiO<sub>2</sub> в процессе прессования.

[1] J.-F. Li, W.-S. Liu, L.D. Zhao, M. Zhou. NPG Asia Mater. 2(4) 152-158 (2010).

[2] S. Wang, N. Mingo. Appl. Phys. Lett. 94(20) 203109-203109-3 (2009).

[3] A.S. Tazebay, S.-I. Yi, J.K. Lee, H. Kim, J.-H. Bahk, S.L. Kim, S.-D. Park, H.S. Lee, A. Shakouri, C. Yu. ACS Appl. Mater. Interfaces 8(11) 7003-7012 (2016).